Zn 掺杂 TiO₂ 薄膜紫外探测器及其光电性能研究

江 伟^{1,2},王 怡¹,邢光建¹,武光明¹,李东临¹

(1. 北京石油化工学院数理系,北京 102617;2. 北京化工大学材料科学与工程系,北京 100029)

摘 要:采用射频磁控溅射的方法制备 Zn 掺杂 TiO₂ 薄膜,用 XRD、SEM 和 UV- Vis 分别表征 TiO₂ 薄膜的 晶体结构、表面形貌及其紫外 - 可见光吸收谱。并用此材料制备 Au/TiO₂/Au 结构 MSM 光电导型薄膜紫外 光探测器,研究其光电特性。实验结果表明,Zn 掺杂 TiO₂ 紫外探测器在 250 nm、5 V 偏压紫外光照下光电 流约为 500 µ A,其响应度为 100 A/W,平均暗电流约为 0.5 µ A;由于 ZnO/TiO₂ 复合薄膜之间的费米能级 不同而形成的内建电场作用,减少了产生的光生电子与空穴的复合,得到较强的光电流。且其光响应的上 升迟豫时间约为 22 s,下降响应时间约为 80 s;响应时间较长是由于广泛分布于薄膜中的缺陷而造成的。 结果表明 Zn 掺杂 TiO₂ 可作为一种良好的紫外探测材料。

关键词:射频磁控溅射;Zn掺杂TiO2薄膜;MSM紫外探测器;光响应 中图分类号:TN36 文献标识码:A 文章编号:1002-0322(2009)03-0038-04

Photocurrent characteristics of ultraviolet photoconductive detectors with Zn doped TiO₂ thin film

JIANG Wei^{1,2}, WANG Yi¹, XING Guang-jian¹, WU Guang-ming¹, LI Dong-lin¹

(1. Department of Mathematics and Physics, Beijing Institute of Petrochemical and Technology, Beijing 102617, China; 2. Department of Materials Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China)

Abstract : The Zn-doped TiO_2 thin films were prepared by RF magnetron sputtering, and their crystal structure, surface morphology and ultra-violet/visible absorption spectra were characterized by XRD, SEM and UV-Vis. Then, the photocurrent characteristics of the MSM-type photoconductive ultraviolet detector prepared with the films in Au/TiO₂/Au system were investigated. The results showed that the detector's photocurrent is 500µA when irradiated by UV light under 5V bias with 250nm wavelength and its responsivity is 100A/W, and the average dark current is 0.5µA. Zn-doped TiO₂ UV detector has a higher photocurrent due to the built-in electric field formed by the different Fermi levels between TiO₂ and ZnO, thus reducing the probability of combining the photoproduced electrons with voids so as to obtain higher photocurrent. The rising relaxation time for photoresponse of the TiO₂ detector is about 22sec, while the lowering response time is about 80sec. The reason why the response time is long is the defects which spread over the film. The sensitivity and stability of the photoresponse indicated that the Zn-doped TiO₂ thin films are proper to be a suitable material for UV detector.

Key words :RF magnetron sputtering; Zn-doped TiO₂ thin film; MSM-type ultra-violet detectors; photoresponse

近年来 TiO₂ 与 ZnO 等作为紫外探测材料已 引起人们的关注。TiO₂ 是一种禁带宽度较大的半 导体材料,其锐钛矿相 TiO₂ 带隙约为 3.2 eV,具 有较高的载流子迁移率^[1],能胜任高温和腐蚀性 环境,有利于制作高性能的紫外光电探测器;但 因 TiO₂ 禁带宽度较宽,受激发产生的电子和空 穴易复合而产生暗电流,进而影响其光电转换 效率^[3]。而 ZnO 作为一种直接带隙宽禁带化合物 半导体材料,其禁带宽度为3.37 eV^[4,5],且具有 激子复合能量高(60 meV)^[6]、电子诱生缺陷较低 等优点,在红外和可见光背景下探测紫外光具有 特殊意义。实验表明薄膜的光电性能与其化学组 成、能带结构、氧空位及结晶度紧密相关,单一薄 膜的光电性能并不很理想,合适的金属离子掺杂 或将具有不同能级的半导体纳米粒子复合在一 起均可以提高电极的光电性能^[8,9]。Zn 掺杂能够

收稿日期:2008-11-08 作者简介:江 伟(1984-),男,湖北省仙桃市人,硕士生。

联系人:王怡,副教授。

改善 TiO₂ 的能带结构^[10],Zn 与 TiO₂ 的复合结构 电极可能会具有更好的光电转换性能。

本文利用射频磁控溅射制备 Zn 掺杂 TiO₂ 薄膜,并制成金属 - 半导体 - 金属(MSM)结构的光电导型探测器,研究 TiO₂紫外探测器的紫外光响应。

1 实验

1.1 TiO₂ 薄膜的制备

实验采用沈阳科仪 JGP 型三靶共溅射高真 空磁控溅射装置,通过直流反应磁控溅射方法, 先在 Si 衬底上镀一层 SiO₂ 绝缘层, 然后在 SiO₂ 表面上制备 Zn 掺杂 TiO2 薄膜。实验以含 2%Zn 的 TiO₂ 陶瓷靶(纯度 99.9%)为靶材,靶面直径为 60 mm、靶厚为 3 mm、Ar 气为溅射气体、O₂ 气为 反应气体。实验中反应压强为 0.8 Pa、反应氧分 压比为 10%、功率为 150 W、衬底温度为 300 ℃。 每次溅射之前,都预先在 Ar 气中预溅射 5 min 左右,以除去靶表面氧化物。薄膜的沉积时间为 60 min, 沉积后的薄膜在 600 ℃下退火 60 min。 然后在制备好的 TiO, 薄膜上溅射一层薄 Au, Au 膜厚为 80 nm 左右,接着采用光刻技术得到 Au 叉指电极,电极指长为2mm,指宽为20µm,指 间隔为 20 µ m ,光敏面积为 4× 5 mm²。MSM 光导 型 TiO₂ 紫外探测器的结构如图 1 所示。



图 1 MSM TiO₂ 紫外探测器结构示意图 Fig.1 Schematic of MSM-typt TiO₂ UV detector

1.2 TiO₂ 薄膜的表征

薄膜的厚度用 AMBIOS XP-1 型台阶仪测试;晶体结构由 SHIMADZU XRD-7000 型 X 射线 衍射仪测试;TiO₂ 薄膜的表面微观形貌与粗糙度 分别由 JSM-6330E 型场发射扫描电镜及 CSPM-4000 型扫描探针观测;其紫外吸收光谱用 UNICO UV-2100 型紫外可见光分光光度计测试; TiO2 紫外探测器的光电特性由 Agilent E5272A 半 导体参数测试仪测量。

2 结果与讨论

2.1 TiO2薄膜晶体结构

图 2 为经 600℃ 退火的 Zn 掺杂 TiO₂ 薄膜 XRD 图谱,从图 2 可以看出,在 34.6°处出现

ZnO 的(002)衍射峰,薄膜为 c 轴择优取向生长(c 轴垂直于衬底表面),这是由于 ZnO(002)晶面具有 最低的表面自由能,而薄膜晶向沿较低表面自由 能方向择优生长,易形成(002)晶面。薄膜中有 TiO₂ 锐钛矿晶向的衍射峰 A(101)、A(004)出现,且衍射 峰很明显,说明薄膜为 TiO₂ 与 ZnO 的复合结构。 且根据台阶仪测得复合薄膜的厚度为 362 nm。



2.2 TiO2 薄膜的表面形貌

图 3、图 4 分别为 Zn 掺杂 TiO₂ 薄膜表面形 貌与 AFM 图,图中可以看出薄膜表层 TiO₂ 为多 孔结构,结晶度很好,没有明显的团聚现象,其平 均颗粒大小约为 60 nm,表面粗糙度为 14.8 nm。 薄膜表面粗糙度的提高使薄膜留有大量孔洞,孔 隙的存在可以使电子深入电极深层,从而使光电 转换过程能持续进行。



图 3 TiO₂ 薄膜的 SEM 图 图 4 TiO₂ 薄膜的 AFM 图 Fig.3 SEM image of TiO₂ thin film Fig.4AFM image of TiO₂ thin film

2.3 TiO₂ 薄膜的紫外 - 可见吸收光谱

图 5 是 Zn 掺杂 TiO₂ 薄膜的透过光谱,图中 可以看出薄膜透过率为 80%左右,根据公式可得 Zn 掺杂 TiO₂ 薄膜的禁带宽度约为 3.32 eV,比 TiO₂ 禁带宽度 3.2 eV 略大,较 ZnO 禁带宽度 3.37 eV 略小。这是由于 TiO₂ 孔隙中掺入了 Zn 能 够改善 TiO₂ 的能带结构。在紫外区 380 nm 附近 出现陡峭的吸收边,说明材料在紫外光范围内有 良好的吸收能力,适合制作紫外探测器。

2.4 TiO₂ 薄膜的紫外探测器的光电特性

图 6 为有无紫外光照时 Au/TiO₂/Au 探测器的 I-V 特性曲线,紫外光照波长与功率分别为 250 nm 与 5 μ W。从图中可以看出,在 5 V 偏压 紫外光照下光电流约为 500 μA,其响应度为 100 A/W,而偏压高于 5 V时,响应度趋于饱和 I-V没有呈明显的线性关系。而在 5 V偏压下测 得平均暗电流约为 0.5 μA,其线性关系表明金 属 Au 与 Zn 掺杂 TiO₂ 薄膜能形成良好的欧姆接 触。暗电流与 X.G.Zheng 等人^[10](ZnO 探测器、暗 电流 250 μA)、Gan Y 等人^[11](TiO₂ 探测器、暗电 流 6 mA)以及 Z.Q.Xu 等人^[12](Al 掺杂 ZnO、暗电 流 15 μA)相比相对较小,表明 Zn 掺杂 TiO₂ 薄膜 能改变 TiO₂ 中杂质能级及深能级结构,有效地抑 制电子 - 空穴的复合,减小暗电流,进而提高光 电性能。



图 5 TiO₂ 薄膜的透过率与吸收光谱 图 6 探测器的 I-V 特性 曲线 Fig.5 Transmittance and absorbance Fig.6 I-V characteristics of spectra of TiO₂ thin films detectors

图 7 为探测器光电流与照射光波长之间的 关系。采用 30 W 的氘灯作为光源由光栅单色仪 得到单色光,偏压为 3 V。由图可以看出,在 230~300 nm 的紫外波段,探测器有很明显的光 响应,且光电流响应比较平坦;在 300~380 nm 区域,光响应明显下降;当波长大于 380 nm 时, 光电流响应又再次趋于平坦,且响应度较 230~ 300 nm 区域下降约 3 个数量级。



的原因是 TiO2 薄膜中含有 ZnO(游离态的 Zn 与 O 结合),而 TiO₂的费米能级在 ZnO 薄膜的费米能 级之下,当二者接触时,会引起费米面的弯曲,导 致 ZnO 薄膜上的电子流动到 TiO2 薄膜上,界面中 TiO₂ 一侧聚集大量电子,ZnO 一侧聚集大量空 穴,在界面间产生了空间电荷层,内建电场的方 向由 ZnO 指向 TiO₂。当载流子迁移到一定程度 时,在内建电场的作用下达到平衡,不再迁移。当 受到紫外光照射时,ZnO 半导体薄膜中产生的光 生电子与空穴分离 同时内建电场的作用减少了 电子和空穴的复合,有效地促进光生载流子产生 并延长了载流子寿命,产生了较强的光电响应。 此外由于 TiO₂ 与 ZnO 的复合使禁带宽度发生变 化,光生电子很快传递到 TiO₂ 导带上,降低了 TiO2 电子 - 空穴复合的几率,增加了光生电子的 密度,提高了光电流响应。

图 8 是电压为 3 V 时所测样品的紫外光时 间响应,TiO2探测器光响应的上升迟豫时间约为 22 s,下降响应时间约为 80 s,较 X.G.Zheng 等 人 ^[10](上升与下降响应时间分别为 17 s、48 s)相 对较长,响应时间较长主要是由于广泛分布于纳 米晶体中的缺陷造成的。光导探测器的响应度决 定于量子效率及光电导增益 (响应度与增益成反 比):(1) Zn 掺杂 TiO, 薄膜表面的缺陷在其禁带间 隙中诱发许多深能级 ,在光照时光生空穴向金属 - 半导体界面处迁移,并被表面态捕获使其带正 电荷 ,导致金属半导体接触势垒高度降低引起光 电导增益;薄膜易形成 Ti、Zn 间隙与 O 空位等失 主能级,当受到光激发后能够产生相对较多的光 生载流子,光电流变小。(2)器件阴极与阳极间有 较宽的间距(20 µ m),导致两个肖特基势垒中间 存在中性区,同样可以引起增益。为提高响应时 间,应该尽量减少晶体缺陷,同时应缩短叉指电 极的指间距,这样光生载流子可以迅速地被内建 电场分离,提高响应时间与对波长的敏感性。

3 结论

采用射频磁控溅射的方法,制备 Zn 掺杂锐 钛矿 TiO₂ 薄膜,并在此薄膜上溅射一层薄 Au 得 到 MSM 光导型 TiO₂ 紫外探测器研究其紫外光响 应。实验结果表明 Zn 掺杂 TiO₂ 紫外探测器在紫 外区域范围有很明显的光响应特性,由于 ZnO 与 TiO₂ 薄膜间的费米能级不同而形成的空间内建 电场的作用,使产生的光生电子与空穴有效分 离,减少了电子和空穴的复合,促进光生载流子 的产生并延长了载流子寿命,得到了较强的光电 流。其光响应的上升与下降迟豫时间分别约为 22 s 与 80 s。为提高 Zn 掺杂 TiO₂ 紫外探测器的 灵敏度和稳定性,应尽量减少晶体的缺陷,同时 缩短叉指电极的指间距。

参考文献

- Shang D M, Ching W Y. Electronic and optical properties of three phase of titanium diopxide: Rutile, analase, and brookite[J]. Physical Review B, 1995, 51:13023-13031.
- [2] Fujishima A, Honda K. Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode [J]. Nature, 1972, (238): 37-38.
- [3] Regan B, Gratzel M. A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO₂ film [J]. Nature, 1991, 353(6):737-739.
- [4] 赵鹏,周旭昌,洪雁,唐利斌,彭曼泽,体晶 ZnO 光导探测器制备与测试 [J]. 红外技术,2007,29 (10): 567-569.
- [5] 刘云燕, 哀玉珍, ZnO 基紫外光电探测器的研究进展[J]. 材料导报, 2007, 21(10):9-12.
- [6] Look D C, et al, Point detect Characterization of GaN and ZnO[J]. Mater Sci Eng B, 1999, 66(13):30-35.
- [7] Reynolds J D C, et al. Time- resolved photoluminescence life time measurements of the free excitons in ZnO [J]. J Appl Plays, 2000, 88(4):2152-2155.
- [8] LI Wei-Hua, QIAO Xue-Bin, GAO En-Qin, et al, Photoelectrochemical behavior of 3d transition metal nanostructured film electrode doped with TiO₂ [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2000,21(10):1534-1538.
- [9] LIN Yuan-hua, YUAN Fang-li, HUANG Shu-lan, LI Jin-lin, Preparation of nanometer ZnO-TiO₂ composite

powders and their characteristics [J]. J. Functional Materia, 1999, 30(5): 507- 508.

- [10] Zheng X G, Li Q S, Chen D, et al, Photoconductive ultraviolet detectors based on ZnO films [J]. Applied Surface Science, 2006, 253:2264-2267.
- [11] 甘勇,刘彩霞,张爽,薛海林,董玮,张歆东.TiO₂ 薄膜紫 外探测器的光电特性[J].半导体学报,2005,26(4): 795-797.
- [12] XU Zi-Qiang, Deng Hong, XIE Juan, LI Yan, ZU Xiao-Tao. Ultraviolet photoconductive detector based on Al doped ZnO films prepared by sol-gel method [J]. Applied Surface Science, 2006, 253:476-479.
- [13] Mandalapu L J, Xiu F X, Yang Z, Liu J L, Ultraviolet photoconductive detectors based on Ga-doped ZnO films grown by molecular-beam epitaxy [J]. Solid-State Electronics, 2007, 51:1014-1017.
- [14] LIU K W, Ma J G, Zhang J Y, Lu Y M, Ultraviolet photoconductive detector with high visible rejection and fast photoresponse based on ZnO thin film [J]. Solid-State Electronics, 2007, 51:757-761.
- [15] 叶志镇,张银珠,等, ZnO 光电导紫外探测器的制备 和特性研究[J]. 电子学报, 2003, 31(11):2112-2116.
- [16] Razeghi M, Rogalski A. Semiconductor ultraviolet detectors[J]. J Appl Phys, 1996, 79:7433-7438.
- [17] SHI Lin- xing, SHEN Hua, JIANG Li- yong, LI Xiang- yin,
 Co- emission of UV, violet and green photoluminescence of ZnO/TiO₂ thin film [J]. Materials Letters, 2007, 61: 4735-4737.
- [18] Mckeag R D, Chan S M, Jackman R B. Poly crystalline diamond photoconductive device with high UV-visible discrimination [J]. Appl Phys Lett, 1995, 67 (15): 2117-2122.

我国铜铟镓硒薄膜太阳电池研制取得突破

据科学网 2009 年 1 月 6 日报道,天津滨海新区的国家 863铜铟镓硒薄膜太阳电池中试基地工艺 设备与大面积材料和器件开发取得了进展,成功研制出有效面积为 804 m²的玻璃衬底铜铟镓硒薄膜 太阳电池组件,其光电转换效率为 7%。

这一成果表明,我国已基本掌握了制造铜铟镓硒薄膜太阳电池设备、工艺以及电池组件制造的主要 核心技术,完成了实验室小面积太阳电池具有生产中试技术的跨越,为自主知识产权生产线开发奠定 了良好的基础。

铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等显著特点,光电转换效率 居各种薄膜太阳电池之首,接近于晶体硅太阳电池,而成本只是它的三分之一,被称为下一代非常有 前途的新型薄太阳电池,是近几年研究开发的热点。此外,该电池具有柔和、均匀的黑色外观,是对于 外观有较高要求场所的理想选择。

由于铜铟镓硒薄膜太阳电池具有敏感的元素配比和复杂的多层结构,因此,其工艺和制备条件的 要求极为苛刻,产业化进程十分缓慢。多年来德国、日本和美国投入巨资开发,目前只有德国 Würth Solar 公司的 15 MW 生产线真正实现了规模生产。

(摘自科学网)